

전착법에 의한 $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 박막의 제작과 결정구조 분석

김영유·이기선*

공주대학 물리교육과 · 충남대학교 물리학과*

Electrochemical Deposition of $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ Thin Films and Analysis of Their Crystal Structure

Young-You Kim · Ki-Seon Lee*

Dept. of Physics Education, Kongju National Univ.
Dept. of Physics, Chungnam National Univ.*

요약

음극 전착법에 의해서 $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 박막을 제작하고 그 결정구조를 조사하였다. 전착 전위 $-0.45V$ vs. Ag/AgCl 근처에서 몰비 x 값에 관계없이 일정한 한계전류가 나타났으며, 생성박막은 몰비 $x=0\sim0.8$ 범위에서 cubic zinc-blende 구조이었으며 $x=1$ 에서 hexagonal wurtzite 구조이었다.

ABSTRACT

$\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0 \leq x \leq 1$) thin films were deposited cathodically on Ti substrates in aqueous sulfirc acid solution containing 1M CdSO_4 and 1mM($\text{TeO}_2 + \text{SeO}_2$). The limiting current was observed in deposition potential ranging from -0.20 to -0.65 vs. Ag/AgCl; although its value has changed a little depending on the mole ratio x , the limiting current was almost constant in deposition potential of $-0.45V$ in spite of the change of mole ratio x . The crystal structure of the $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ thin films was cubic zinc-blende in the range of mole ratio $x=0\sim0.8$, and hexagonal wurtzite in the mole ratio $x=1$. When the mole ratio changed from $x=0$ to $x=0.8$, diffraction peaks was shifted to the larger diffraction angle.

I. 서 론

II-VI족 화합물 반도체(CdS, CdSe, CdTe 등)는 직접 천이형의 반도체로서 광흡수 계수가 커서 태양에너지의 높은 변환 효율을 얻을 수 있을 것으로 기대되고, 또한 III-V족 화합물 반도체에 비해 박막의 제작이 용이하기 때문에 값싸고 효율이 높은 태양전지용 재료로서 광범위하게 이용할 수 있을 것으로 평가되고 있다.^{1), 2)}

태양전지의 실용화를 위해서는 생산 원가가 저렴하고 면적이 큰 반도체를 제작해야 한다. 단결정 반도체는 효율의 측면에서 이상적인 태양전지용 재료이지만 제작원가가 높고 면적이 큰 반도체 제작이 어렵기 때문에 근년에는 다결정 박막 반도체가 태양전지용 재료로서 주목을 받고 있다. $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 박막 반도체는 그 결정 구조와 화학량론 비(stoichiometry ratio)에 따라 energy band gap이 1.35~1.45eV 정도로서 태양빛을 전기 에너지로 변환하는 데 거의 이상적이기 때문에 중요한 태양전지용 변환 재료중의 하나로 각광받고 있다.

$\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 반도체 박막의 전착법에 의한 제작과 특성 및 응용에 관한 연구는 1980년대 들어서 시작되었으나 현재까지는 주로 2원계 박막인 CdSe에 대한 연구와 CdTe에 대한 연구가 각각 별도로 진행되고 있는 실정이다. 이에 대한 주요한 연구 결과를 살펴보면, 1982년 G.Hodes³⁾은 CdSe와 CdTe박막을 0.2M CdSO_4 와 10mM SeO_2 그리고 20mM TeO_2 를 알카리 용액속에서 전착 전위 -650mV vs. SCE(saturated calomel electrode)의 조건속에서 Ti 기판 위에 전착시키고 그 결정 구조를 조사하였으며, 1985년 M.Abramovich⁴⁾은 0.006M SeO_2 +0.024M TeO_2 +0.2M CdSO_4 +1M H_2SO_4 의 전해액 속에서 전착전위 -0.7V vs. SCE의 조건에서 $\text{CdSe}_{0.65}\text{Te}_{0.25}$ 박막을 제작하여 결정 구조와 photoluminescence spectrum 등을 조사한 바 있다. 그리고 J.H. Rosamilia⁵⁾등은 전착 CdTe박막의 응용에 대한 기초 연구를, K. Uosaki⁶⁾⁻⁸⁾등은 전착 CdTe박막의 특성에 대한 연구를, R.D. Engelken⁹⁾등은

전착 CdTe박막의 생성 mechanism 규명에 대한 기초 연구를 수행해 오고 있으며, 그 외에도 전착 Cd-Chalcogenide박막에 대한 연구가 계속적으로 이루어지고 있다.¹⁰⁻¹³⁾

본 연구에서는 II-VI족 반도체 재료인 $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 3원계 박막을 음극전착법으로 제작하고 그 생성반응과 결정구조를 조사하였다.

II. 실 험

1. 박막의 제작

$\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ ($0 < x < 1$, x의 간격 0.2) 박막을 제작하기 위해서 CdSO_4 (Wako Chemical Co., 순도 99.5%), SeO_2 (Wako Chemical Co., 순도 99%), TeO_2 (Wako Chemical Co., 순도 99%)를 사용하였으며 전해액은 1M CdSO_4 와 1mM($\text{SeO}_2 + \text{TeO}_2$)를 혼합하여 TeO_2 가 최대로 용해되는 pH 1.4¹⁴⁾인 상태에서 반도체 제작용 DI water(Fisher Scientific Co., HPLC Grade)를 이용하여 준비하였다. 기판은 Ti판 (Nilaco Co., 두께 0.3mm)을 사용하였으며 사용 전에 chloroform과 ethyle alcohol로 5-6회 정도 닦은 후 chloroform 증기를 2-3분간 쪼여 기름 성분을 제거한 다음 순수로 닦아내었다. 그리고 실험을 시작하기 전에 47% HF(Morita Kagaku Kogyo Co., Ltd., 특급) 용액에 2분 동안 담가서 기판 표면의 산화층을 제거하였다. 이렇게 처리된 기판을 teflon으로 만든 holder로 고정시켜서 작동 전극으로 사용하였으며 그 면적은 약 0.79cm²이었다.

보조 전극은 백금박(Nilaco Co., 순도 99.98%, 두께 0.3mm, 면적 약 20cm²)을 사용하였으며 기준 전극으로는 Ag/AgCl 전극(Aldrich Chemical Co.)을 사용하였다.

전착 전위는 Potentiostat(Hokuto Denko Co., HA 301)를 이용하여 필요한 전압을 일정하게 조절하였다.

박막의 제작은 실온에서 실시하였으며, 박막의 광학적 특성을 높이기 위하여 암실에서 실시하였다.¹⁵⁾ 전해액은 사용 직전에 고순도 질소 기체를 약 20분 동안 통과시켜서 용액 속에 녹아 있는 산소를 충분히 제거하였다.

2. 박막의 열처리 및 결정구조 분석

제작한 박막의 열처리는 150°C , 350°C 및 500°C 에서 4시간 동안 실시하였다. 열처리를 할 때의 승온, 강온, 보온 시간 등은 Digital Program Controllers(DEX-P100, RKC Instrument Inc.)를 사용하여 조절하였다. 그리고 열처리 시에 박막의 산화를 방지하기 위하여 고순도의 헬륨 기체를 박막에 계속적으로 통과시켰다. 제작된 박막의 결정 구조를 조사하기 위하여 X-선 회절 장치(Rigaku, RU-200)를 이용하여 회절 강도와 산란각 θ 를 측정하였다. 이 때 가속 전압은 40kV , 전류는 20mA 이었으며, 회절 강도는 기록계에 자동으로 기록되도록 하였다. 단색 X-선을 얻기 위하여 target는 파장이 1.5405\AA 인 $\text{CuK}\alpha$ 로, 필터는 Ni을 사용하였다.

III. 결과 및 고찰

1. $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 박막의 생성 반응

전착 장치에 1M CdSO_4 와 $1\text{mM}(\text{SeO}_2 + \text{TeO}_2)$ 가 포함된 $\text{pH}=1.4(18^{\circ}\text{C})$ 의 전해액을 넣고 정전위법에 의해 Ti기판을 작동 전극으로 할 때 전착 전위와 환원 전류 사이의 관계는 Fig.1과 같다. 어느 경우에도 몰비(mole ratio) x 값에 관계없이 전착전위가 0V vs. Ag/AgCl 에서 $(-)$ 쪽으로 증가하면서 환원 전류가 흐르기 시작하여 $(-)$ 쪽으로 증가하다가 거의 일정한 한계 전류를 나타내고 있다. SeO_2 의 비율이 증가할수록 환원 전류가 나타나는 전위가 $(-)$ 쪽으로 shift되었다. 이와 같은 현상은 Te전착에 필요한 표준 전위보다 Se 전착에 필요한 표준 전위가 더 $(-)$ 쪽에 있기 때문으로 생각된다. 또한 전착 전위가 -0.65V 보다 더 낮아지면 매우 큰 환원 전류가 관측되는데 이것은 -0.65V 보다 낮은 전착 전위에서는 금속 Cd가 석출되기¹⁶⁾ 때문에 TeO_2 나 SeO_2 의 농도에 관계없이 대단히 큰 환원 전류가 흐르게 된다고 생각된다.

한편 전착 전위 $-0.20\text{V} \sim -0.60\text{V}$ 사이에서 $\text{TeO}_2 + \text{SeO}_2$ 의 확산에 의하여 나타나는 일정한 한계 전류(limiting current)가 관측되었다. 이

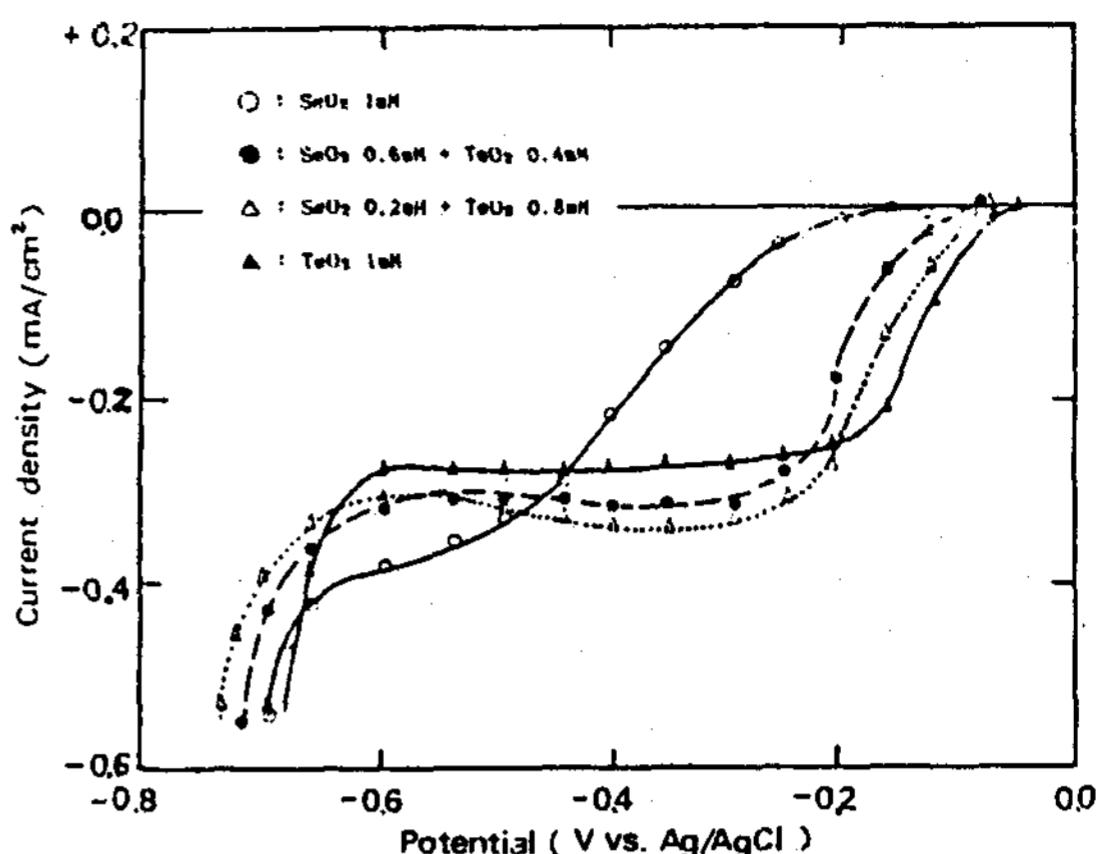


Fig.1 Current density-deposition potential relations of Ti electrode in sulfuric acid solution containing 1M CdSO_4 and $1\text{mM}(\text{SeO}_2 + \text{TeO}_2)$

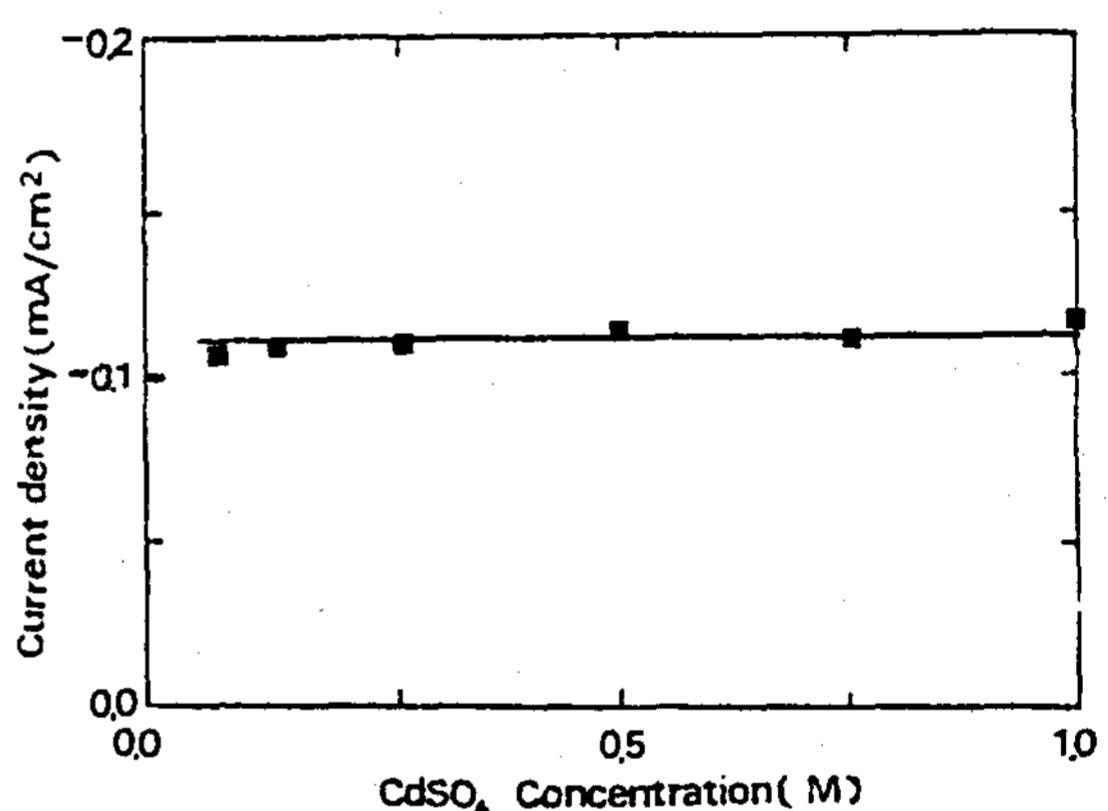


Fig.2 CdSO_4 concentration dependence of the current density at -0.45V vs. Ag/AgCl

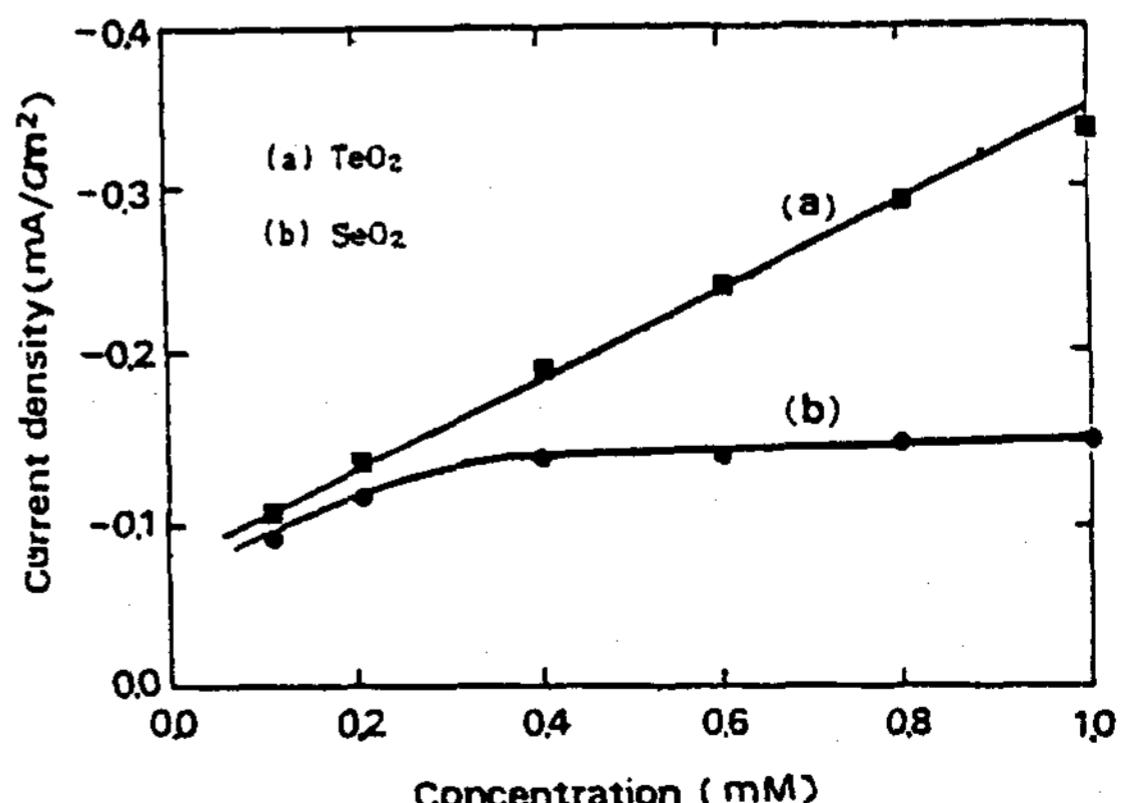


Fig.3 TeO_2 and SeO_2 concentration dependence of the current density at -0.45V vs. Ag/AgCl

한계 전류 영역에서는 TeO_2 나 SeO_2 의 확산에 의해 전류의 크기가 영향을 받게 될 것이므로 용액 중의 TeO_2 와 SeO_2 의 몰비에 비례하여, 전착 박막 중의 Te와 Se가 조성되어 $\text{CdSe}_x\cdot\text{Te}_{1-x}$ 박막이 생성되는 것으로 생각된다.

여기서 관측된 한계 전류와 CdSO_4 의 농도 사이의 관계를 조사해 보면 Fig.2와 같고 한계 전류와 TeO_2 및 SeO_2 의 농도 사이의 관계는 Fig.3과 같다. 이 결과 전착 전위 $-0.20\text{V} \sim -0.60\text{V}$ 에서 나타난 한계 전류는 CdSO_4 의 농도 변화에 관계없이 일정하며 TeO_2 및 SeO_2 의 농도에는 비례하였다.

표면의 uniformity는 약 15% 오차이었으며 헬륨 기체 속에서 350°C 로 4hrs의 열처리에 의해 오차 5~7%정도로 균일해졌다. 몰비 x 의 값에 따라 한계 전류가 조금씩 차이가 나기 때문에 같은 제작 조건에서 두께는 몰비 x 값에 따라 조금씩 차이가 있다. $x=0$ 인 경우, 즉 CdTe 박막은 약 18°C 에서 15hrs동안 전착한 결과 그 두께는 약 $3.5\ \mu\text{m}$ 이었다. 이 결과는 A. Mondal¹⁷⁾가 CdS 박막을 18hrs 전착하여 $3\ \mu\text{m}$ 의 두께를 얻은 결과와, G. Fulop¹⁸⁾가 CdTe 박막을 20hrs 전착하여 $4\ \mu\text{m}$ 의 두께를 얻은 결과와 비슷하였다.

3. 생성 박막의 결정 구조

한계 전류 범위 내의 전착 전위 -0.45V vs. Ag/AgCl 에서 박막을 제작한 결과 기판 위에 검은 색의 물질이 전착되었다. 이 물질의 결정 구조를 알아 보기 위하여 생성 박막의 X선 회절 측정을 한 결과 Fig.4와 같은 회절 peak를 얻었다.

Fig.4(a)에서와 같이 몰비 $x=0$ 인 CdTe 박막의 회절 peak는 기판(Ti)의 회절선 외에 $2\theta = 23.8^\circ, 39.3^\circ, 46.3^\circ$, 및 CdTe 의 (111), (220), (311)면에 대응하는 회절 peak¹⁹⁾가 아주 약하게 나타났지만, cubic zinc-blende 구조를 가진 CdTe 박막이 생성되었음이 확인되었다.

이 결과는 R.N. Bhattacharya²⁰⁾에 의해 보고된 전착 CdTe 박막 결정 구조와도 일치하였다. 몰비 x 값이 $0.2 \sim 0.8$ 사이에서는 Fig.4(b)와 같이 회절 peak의 강도가 미약하여 결정 구조를 얻

기기 어려웠으며 $x=1$ 인 경우, 즉 CdSe 박막에서는 Fig.4(c)에서와 같이 일반적으로 알려진 CdSe 의 안정한 구조인 hexagonal wurtzite 구조²¹⁾의 회절 peak가 확실하게 나타났다. 한편 몰비 $x=0 \sim 0.8$ 사이에서는 이 peak 외에 $2\theta = 27.8^\circ$ 에 금속 Te의 (102)면에 의한 회절선²²⁾가 관측되었다. 이 결과로 박막이 생성될 때 금속 Te도 함께 석출됨을 확인할 수 있었다.

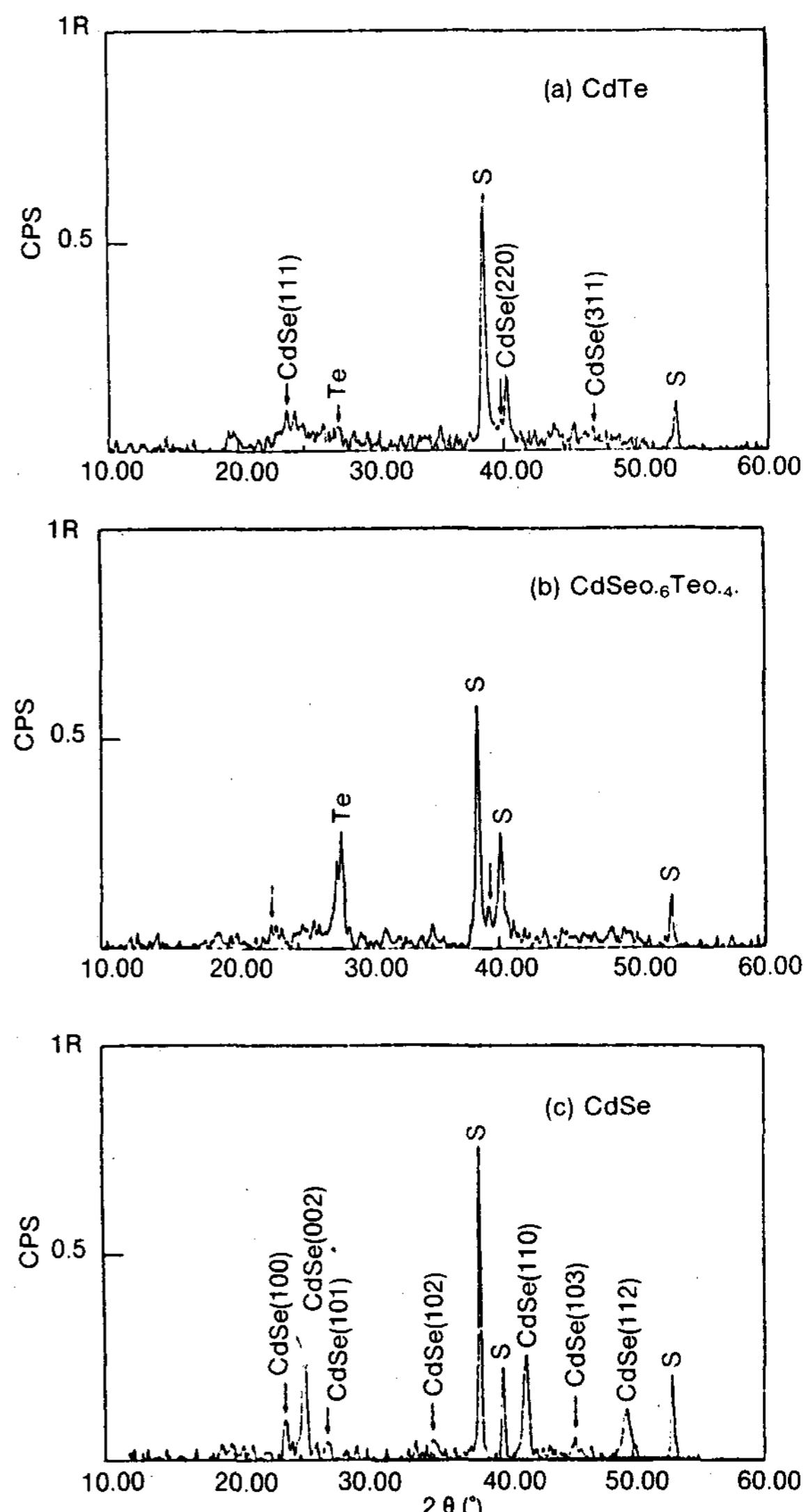


Fig.4 X-ray diffraction patterns of the films deposited in sulfuric acid solution containing 1M CdSO_4 and 1mM($\text{TeO}_2 + \text{SeO}_2$) at -0.45V vs. Ag/AgCl .

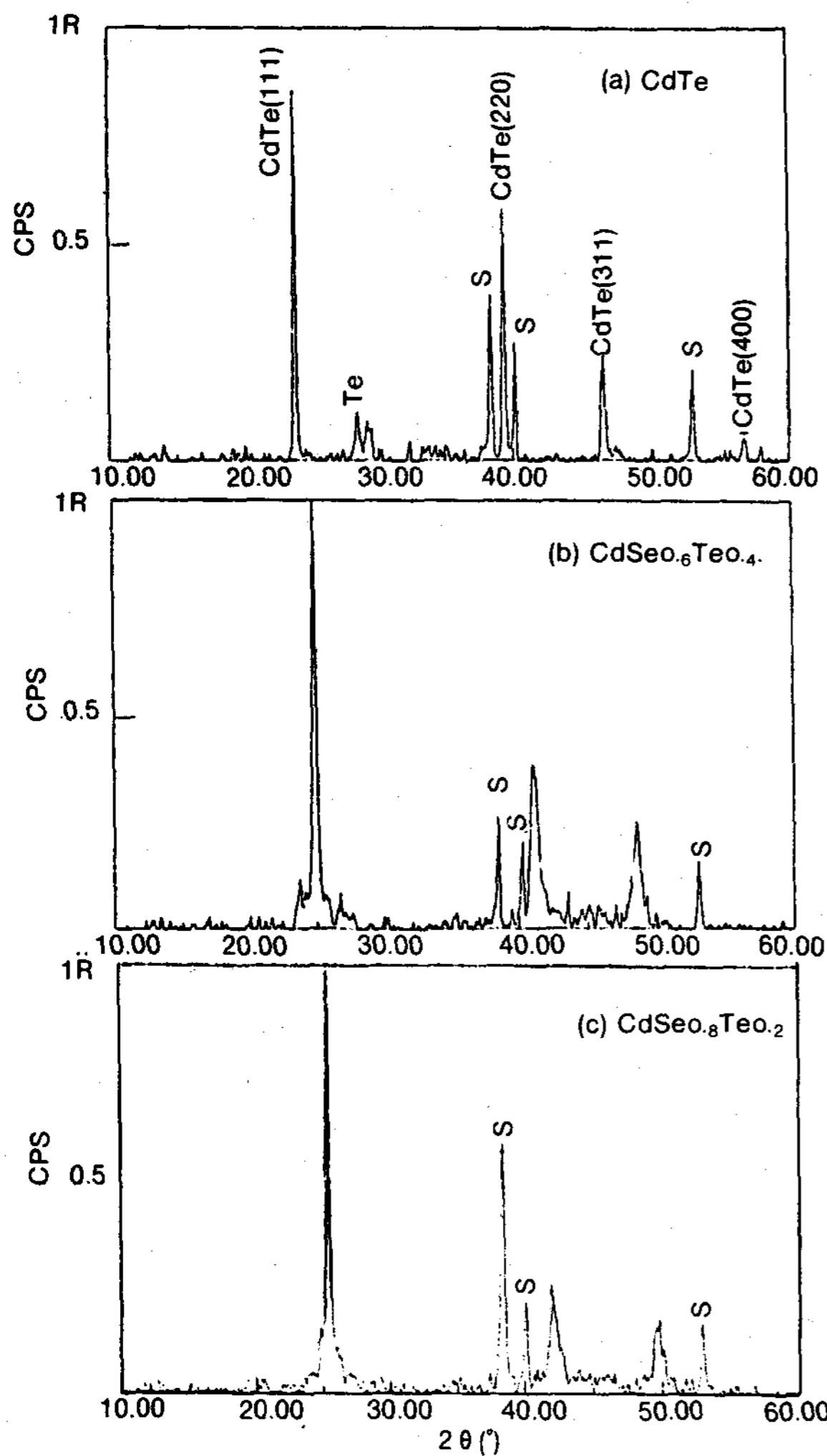


Fig.5 X-ray diffraction patterns of the films deposited in sulfuric acid solution containing 1M CdSO_4 and 1mM($\text{TeO}_2 + \text{SeO}_2$) at -0.45V vs. Ag/AgCl and annealed at 350°C for 4hrs in He gas

결정화도를 향상시키고 회절 peak 사이의 상관관계를 명확히 얻기 위하여 헬륨 기체 속에서 350°C로 4시간 열처리를 한 후 X선 회절 측정을 하였다. 그 결과 Fig.5와 같은 X선 회절 peak를 얻었다. 열처리에 따라 각 결정면에 대응하는 회절 peak의 강도가 훨씬 증가하고 x 값이 0에서 0.8까지 증가함에 따라 회절 peak의 위치가 회절각이 큰쪽으로 shift되어 나타나는 것을 알 수 있었다. 이 결과로 몰비 $x=0\sim 0.8$

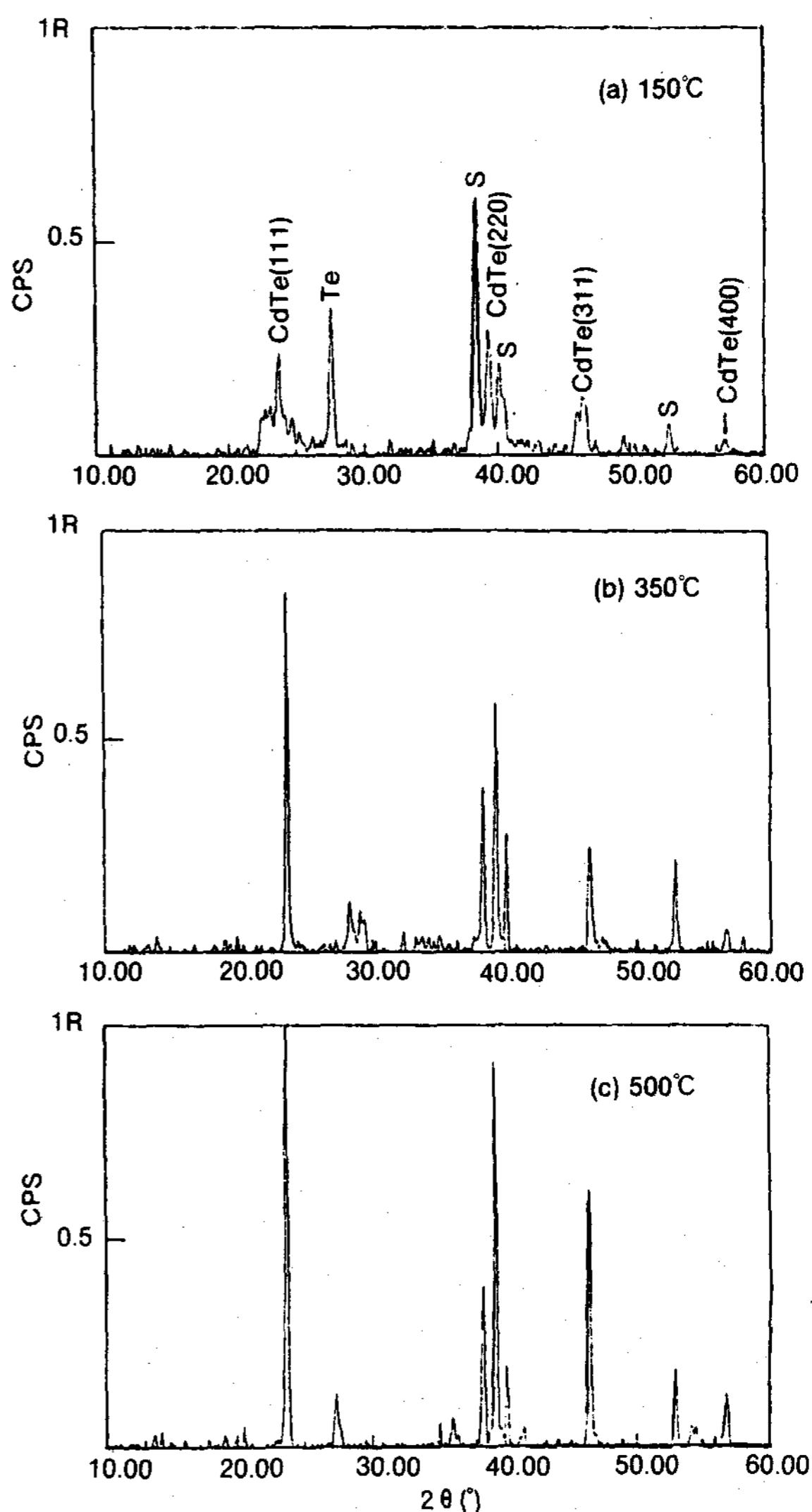


Fig.6 X-ray diffraction patterns of the CdTe films annealed at 150°C, 350°C, and 500°C, for 4hrs in helium gas

사이에서 제작된 박막의 구조는 모두 cubic zinc-blende 구조이며, $x=1$ 인 경우, 즉 CdSe 의 박막은 hexagonal wurtzite 구조임을 알 수 있었다. 그리고 열처리에서 의해 금속 Te의 회절 peak는 상당히 감소되는데 이것은 금속 Te가 박막에서 증발되었다는 것을 암시한다.

전해액 중에 TeO_2 가 포함이 된 경우에 제작된 박막에서의 결정 구조가 cubic zinc-blende로 나타나는 까닭은 Fig.3에서 알 수 있는 바와

같이 TeO_2 가 한계 전류에 미치는 영향이 SeO_2 보다 크기 때문인 것으로 여겨진다.

한편, 열처리 온도와 X선 회절 peak 강도 사이의 관계는 Fig.6과 같다. 몰비 x 값이 0인 CdTe 박막에서 열처리 온도가 증가할수록 박막의 회절 peak의 강도는 증가하였다. 특히 $2\theta = 46.3^\circ$ 에 CdTe 의 (400)면¹⁹⁾의 peak까지도 확실하게 나타났다. 이 때 금속 Te의 peak는 반대로 감소하므로 열처리를 통해 금속 Te를 제거시킬 수 있었다. 실제로 Fig.7에서와 같이 열처리 온도가 증가하면 CdTe (111면)의 회절 peak의 강도는 증가하며 금속 Te의 peak는 상대적으로 감소되는 것을 알 수 있었다. 이것은 여분의 금속 Te를 가지고 있는 박막을 열처리하면 금속 Te는 표면으로부터 먼저 증발하고 결정 내의 Te의 분열 반응은 최대한 억제되기 때문이라고 생각된다.

결론적으로, 몰비 $x=0$ 인 경우에서 얻어진 CdTe 박막을 헬륨 기체 속에서 500°C 로 4hrs 동안 열처리한 결과 ASTM data¹⁹⁾와 거의 같은 순수한 구조를 얻을 수 있었다.

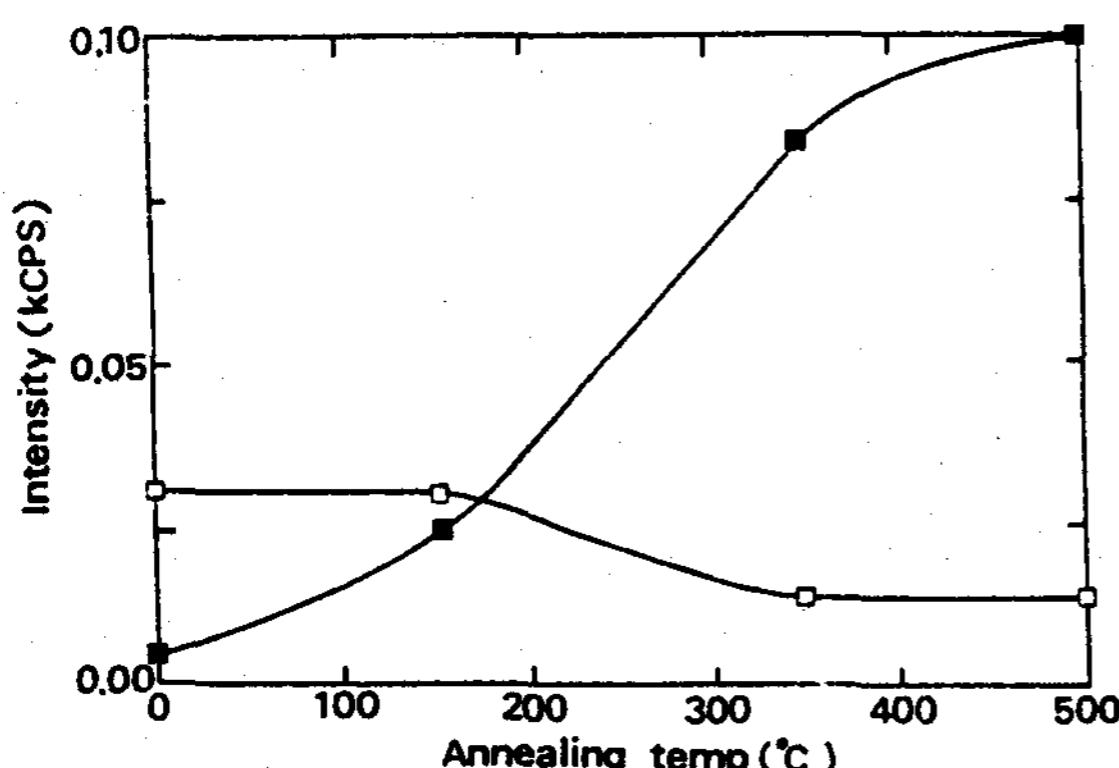


Fig.7 Annealing temperature dependence of the intensity of the X-ray diffraction peak due to $\text{CdTe}(111)$ face(■) and free Te(□) in the films used for experiments presented in Fig.6.

V. 결 론

본 연구에서는 태양에너지 변환 재료 중의

하나인 $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 계 화합물 반도체 박막을 전착법으로 제작하는 방법을 확립하기 위해 그 생성 반응과 결정구조를 조사하였다.

- 1M CdSO_4 와 1mM($\text{SeO}_2 + \text{TeO}_2$)가 포함된 pH=1.4인 전해액에서의 한계 전류는 전착 전위가 $-0.20 \sim -0.65\text{V}$ vs. Ag / AgCl에서 나타나며 그 값은 몰비 x 값에 따라 차이가 있다. 한계 전류는 전착 전위 -0.45V 근처에서 몰비 x 값에 관계없이 거의 일정하며 이 전류 내에서 전착 $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 반도체 박막의 제작이 가능하였다. 또한 이 한계 전류는 $[\text{CdSO}_4]$ 의 농도에는 거의 무관하며 $[\text{TeO}_2]$ 의 농도에 비례한다.
- 박막의 두께는 전착 시간에 비례하며, 몰비 $x=0$ 인 경우에 18°C 에서 15시간의 전착으로 약 $3.2\text{ }\mu\text{m}$ 의 CdTe 박막을 얻었다.
- 전착 전위 -0.45V vs. Ag/AgCl에서 제작한 $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ 박막은 몰비 $x=0 \sim 0.8$ 범위에서 cubic zinc-blende 구조를 가지며, x 의 값이 커질수록 X선 회절 peak는 회절각이 큰쪽으로 shift되어 나타났다. 그리고 몰비 $x=1$ 인 경우에는 hexagonal wurtzite 구조를 가진다.
- X선 회절 측정 결과 금속 Te peak도 함께 나타나는 것으로 보아 박막 표면에 금속 Te가 존재하고 있는 것으로 판단되며, 이 peak는 헬륨 기체속에서 350°C 로 4시간 동안 열처리를 하여 거의 소멸시킬 수 있었다. 따라서 몰비 $x=0$ 인 박막을 열처리하여 순수한 single phase CdTe 를 얻을 수 있다.

REFERENCES

- J.G. Werthen, J.P. Haring, A.L. Fahrenbruch, R.H. Bube, J. Appl. Phys., 54, 5982(1983).
- 辻高輝, 太陽電池(パワ一社, 1986) p.41.
- G. Hodes, J. Manassen and S. Neagu, Thin Solid Films, 90, 436(1982).
- M. Abramovich, M.J.P. Brasil, F.Decker, J.R. Moro and P. Motisuke, J. of Solid State Chemistry, 59, 4(1985).

5. J.M. Rosamilia and B. Miller, *J. Electroanal Chem.*, 215, 249(1986).
6. K. Uosaki, N. Karube, T. kadowaki, S. Sato and H. Kita, *J. Chem. Society of Japan*, 11, 2006(1987).
7. K. Uosaki, H. Kita, *Electrochim. Acta*, 29, 279(1984).
8. M. Takahashi, K. Uosaki and H. Kita, *J. Electrochem. Soc.*, 133, 266(1986).
9. R.D. Engelken, T.P. Van Doren, *J. Electrochem. Soc.*, 132, 2904(1985).
10. M. Skyllas-Kazacos and B. Miller, *J. Electrochem. Soc.*, 127, 2378(1980).
11. M. Skyllas-Kazacos and B. Miller, *J. Electrochem. Soc.*, 127, 2378(1980).
12. M.A. Russak and C. Creter, *J. Electrochem. Soc.*, 131, 556(1984).
13. B. Miller and J.M. Rosamilia, *Anal. Chem.*, 55, 1281(1983).
14. S.I. Zhdanov, in *Encyclolopedia of Electrochemistry of the Elements*, ed. by A.J. Bard(Marcel Dekker Inc., New York, 1975) Chap IV-8.
15. K. Uosaki, unpublished, Hokkaido Univ., Japan.
16. K. Uosaki, M. Takahashi and H. Kita, *J. Appl. Phys.*, 55, 3879(1984).
17. A. Mondal, T.K. Chaudhuri and P. Pramanik, *Solar Energy Materials*, 7, 431(1983).
18. G. Fulop, M. Doty, P. Meyers, J. Betz, and C.H. Liu, *Appl. Phys. Lett.*, 40, 327(1982).
19. ASTM X-Ray Powder Data, 15-770.
20. R.N. Bhattacharya, *J. of Applied Electrochemistry*, 16, 168(1986).
21. ASTM X-Ray Powder Data 8-459.
22. ASTM X-Ray Powder Data 4-554.

Electrochemical Deposition of CdSe_xTe_{1-x} Thin Films and Analysis of Their Crystal Structure

Young-You Kim · Ki-Seon Lee*

Dept. of Physics Education, Kongju National Univ.

Dept. of Physics, Chungnam National Univ.*

ABSTRACT

CdSe_xTe_{1-x}(0≤x≤1) thin films were deposited cathodically on Ti substrates in aqueous sulfric acid solution containing 1M CdSO₄ and 1mM(TeO₂+SeO₂). The limiting current was observed in deposition potential ranging from -0.20 to -0.65 vs.Ag/AgCl; although its value has changed a little depending on the mole ratio x, the limiting current was almost constant in deposition potential of -0.45V in spite of the change of mole ratio x. The crystal structure of the CdSe_xTe_{1-x} thin films was cubic zinc-blende in the range of mole ratio x=0~0.8, and hexagonal wurtzite in the mole ratio x=1. When the mole ratio changed from x=0 to x=0.8, diffraction peaks was shifted to the larger diffraction angle.

The Fabrication of n⁺-p⁺ InP Solar Cells by the Diffusion of Sulphur

Ki Ung Jung · Seon Tai Kim · Dong Chan Moon

Electronics & Telecommunication Research Institute

Department of Materials, Daejeon National University of Technology*

Department of Electronic Materials, Kwang Woon University**

ABSTRACT

n⁺-p⁺ InP homojunction solar cells were fabricated by thermal diffusion of sulphur into a -p⁺-InP wafer($p=4\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$), and a SiO film(600A° thick) was coated on the n⁺ layer as an antireflection (AR) coating by an e-beam evaporator. The volume of the cells were $5\times 5\times 0.3\text{mm}^3$. The front contact grids of the cells with 16 finger pattern of which width and space were $20\mu\text{m}$ and $300\mu\text{m}$ respectively were formed by photolithography technique.

The junction depth of sulphur were as shallow as about $0.4\mu\text{m}$. We found out the fabricated solar cells that, with increasing the diffusion time, short circuit current densities(J_{sc}), series resistances(R_s) and energy conversion efficiencies(η) were increased.

The cells show good spectral responses in the region of 5,000–9,000A°. The short circuit current density, the open circuit voltage(V_{oc}), the fill factor(F.F) and the energy conversion efficiency of the cell were 13.16mA/cm^2 , 0.38V , 53.74% and 10.1% respectively.